

第2回 集積化MEMS技術研究会 会告

応用物理学会・集積化MEMS技術研究会
委員長 石田 誠 (豊橋技術科学大学)

集積化MEMSは、次世代のデバイス・システム研究開発を担う More than Moore 技術として近年とくに脚光を浴びています。本研究会は、MEMSとLSIの両技術分野の融合と新たなテーマ開拓に向けて、材料、プロセス、デバイス構造、実装技術、高歩留まり技術、高信頼化技術等を視野に、学問的見地から実用化に至るまでのホットな議論の場を提供します。多くの方の投稿、参加をお願い申し上げます。

今回、招待講演として、河村誠一郎氏((株)半導体先端テクノロジーズ(Selete))から「More than Moore と MEMS」、藤田博之先生(東京大学生産技術研究マイクロメカトロニクス国際研究センター)から「MEMSによる異機能集積プロセス」のご講演を頂く予定です。

(集積化MEMS技術研究会HP及び入会手続きはこちら <http://masu-www.pi.titech.ac.jp/MEMS/>)

- 【開催日時】 平成 20 年 11 月 21 日 (金) 9:30~17:00
- 【開催会場】 東京大学生産技術研究所 An 棟 4 階、中セミナー室 (An-401, An-402)
研究所HP <http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/>
交通アクセス <http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/access/access.html>
(生産研 An 棟は、代々木上原駅からは、正門を入れて一番奥の芝生広場の前にある建物です。
駒場東大前駅からは、東門を入れて生産研の建物を通り抜けた後に、左側に見える建物です。)
- 【講演申込】 講演時間 15 分予定。指定様式の 1 ページ・サマリー (添付 1 : HP 参照) に記載し、平成 20 年 10 月 24 日 (金) までにメールにてお申し込み下さい。
<http://masu-www.pi.titech.ac.jp/MEMS/>
- 【参加申込】 聴講および見学参加ご希望の場合にも、事前申し込みが必要です。
参加者記入用指定様式 (添付 2 : HP 参照、もしくは下記メール申し込み内容) に記載し、平成 20 年 10 月 31 日 (金) までにメールにてお申し込み下さい。
- 【参加費】 一般会員、賛助会員、学生会員及び学生非会員、特別会員、及び入会手続き中の会員は無料、非会員は 4,000 円
- 【懇親会】 研究会終了後に、東京大学生産技術研究所内で懇親会を予定しています。
お誘い合わせの上、ご参加下さい。時間 17:30-19:30、会費 3,000 円 (見込)。
- 【プログラム】 講演プログラムは、後日 HP 等で公開予定です。
- 【CR見学】 生産技術研究所・先端科学技術研究センターのクリンルーム見学を予定しています。
研究会会場に 11:00 までにお集まり下さい。見学時間 11:10~12:00 (見込)。
- 【講演・参加申込先、問合先】
町田克之 (NTT アドバンステクノロジー (株))
e-mail: katsuyuki.machida@ntt-at.co.jp
◎申し込みは、下記情報をご記入後、電子メールにてお願いします。

応用物理学会 第2回 集積化MEMS技術研究会 参加申込

氏名 _____
所属機関 _____
電子メール _____@_____
電話 _____
連絡先住所 〒 _____
研究会会員 : 会員 / 非会員
午前のCR見学参加の有無 : 参加 / 不参加
当日の研究会参加の有無 : 参加 / 不参加
夕方の懇親会参加の有無 : 参加 / 不参加